

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

1. ФИО: **Сушенцов Николай Иванович**
2. Ученая степень, научная специальность: **кандидат технических наук, 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника на квантовых эффектах.**
3. Место работы: **ФГБОУ ВПО Поволжский государственный технологический университет**
4. Должность: **заведующий кафедрой конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры**
5. Публикации по теме оппонируемой диссертации за последние 5 лет:

1. Сушенцов Н.И., Мороз А.В., Степанов С.А., Попов И.И., Вашурин Н.С., Хадиев А.Р. Технологические методы формирования тонких пленок // Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2014. Т. 78. № 3. С. 313.

2. Попов И.И., Вашурин Н.С., Путилин С.Э., Степанов С.А., Сидорова В.Т., Сушенцов Н.И. Фотонное эхо в однослойных и трехслойной полупроводниковых пленках различной наноразмерной толщины и исследование их свойств // Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2014. Т. 78. № 2. С. 229.

3. Popov I.I., Vashurin N.S., Sidorova V.T., Stepanov S.A., Sushentsov N.I., Putilin S.E. Signals of the femtosecond photon echo in inorganic films and their recording // Physics of Wave Phenomena. 2013. Т. 21. № 1. С. 38-40.

4. Каменева А.Л., Сушенцов Н.И., Клочков А.Ю. Зависимость морфологии, свойств, теплового и напряженного состояния пленок от технологических параметров магнетронного распыления // Технология металлов. 2010. № 11. С. 38-42.

5. Каменева А.Л., Сушенцов Н.И., Трофимов Е.М. Изучение влияния технологических и температурных условий формирования пленок на основе Ti-Al-N методом электродугового испарения на их структуру, свойства, механизм и стадии формирования // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. 2010. Т. 12. № 1. С. 63-75.